

走査型白色干渉計

【アメテック株式会社 ZYGO NewView9000】

【設備の特徴】

走査型白色干渉計は、顕微鏡タイプの干渉計です。白色LED光源から干渉対物レンズを通した白色光によって、被測定物の反射光と対物レンズ内の参照面からの反射光との間の干渉像を取得することによって、サブナノメートルオーダーの垂直分解能で三次元表面形状像を非接触計測する装置です。樹脂、金属加工面、光学研磨面、半導体デバイスなど、様々な材料の形状測定に活用することができます。

【設備の仕様概要、技術内容】

■主な特長

- ・非接触で表面性状をサブナノメートルオーダーで測定が可能
- ・ステッチング機能により、高倍率像の重ね合わせ画像の取得が可能
- ・オートフォーカス・オートチルトなど、測定支援機能が充実



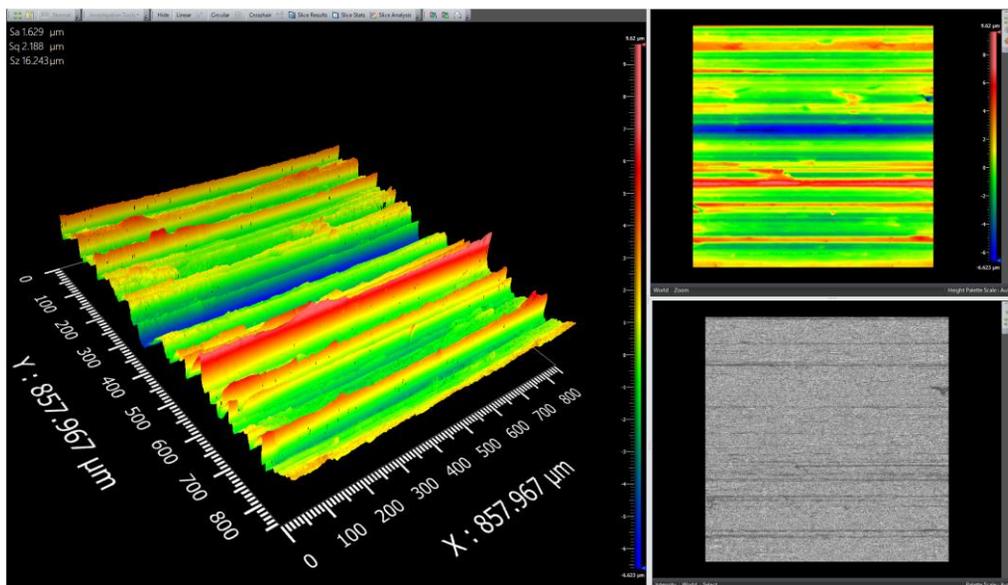
■仕様概要

垂直分解能	0.008nm
試料ステージサイズ	□200mm
搭載可能試料高さ	約60mm
所有対物レンズ	SLWD1x、2.5x、10x、50x、100x
光学ズーム	0.5x、1x、2.0x
測定支援機能	自動焦点合わせ、 自動傾斜調整(≦±3°)、衝突検知機能

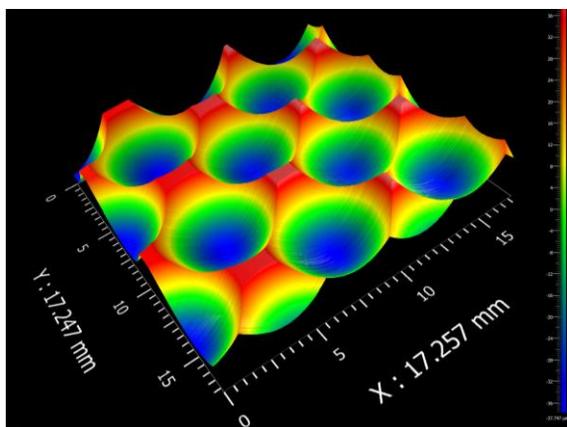
■効果が期待される利用分野

1. 輸送機器産業分野(自動車・航空機部品等の加工品や金型の表面性状評価)
2. エレクトロニクス産業関連分野(電気・電子部品、光学部品などの表面性状評価)
3. その他(部品の摩耗観察、研磨ウェハの表面性状評価など)

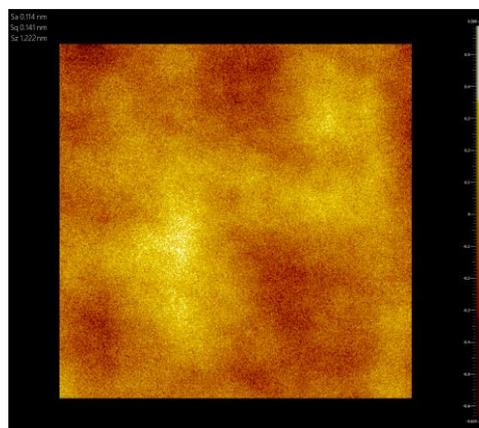
【測定事例】



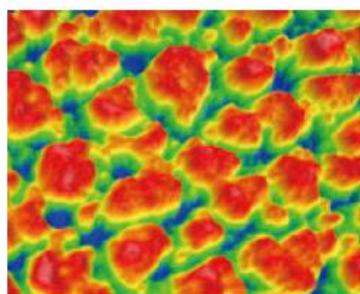
Ti研削面 (SD#140, Sa 2.603 μ m)



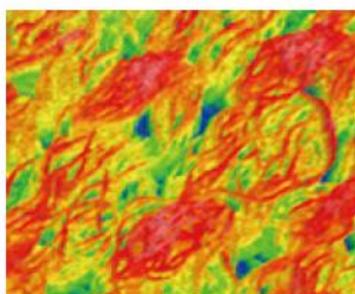
レンズアレイ 6×6面貼り合わせ画像:
測定視野 □17.3mm



ガラス研磨面: 面粗さSa 0.114nm

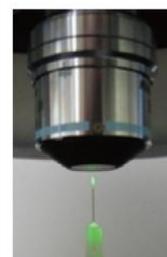


シボ



布

注射針



【お問い合わせ先】

秋田県産業技術センター

先進プロセス開発部 システム制御チーム

久住 孝幸

TEL: 018-862-3414 / FAX: 018-865-3949

E-Mail: soudanshitu@aitc.pref.akita.jp

〒010-1623 秋田県秋田市新屋町字砂奴寄4-11 / <https://www.aitc.pref.akita.jp/>